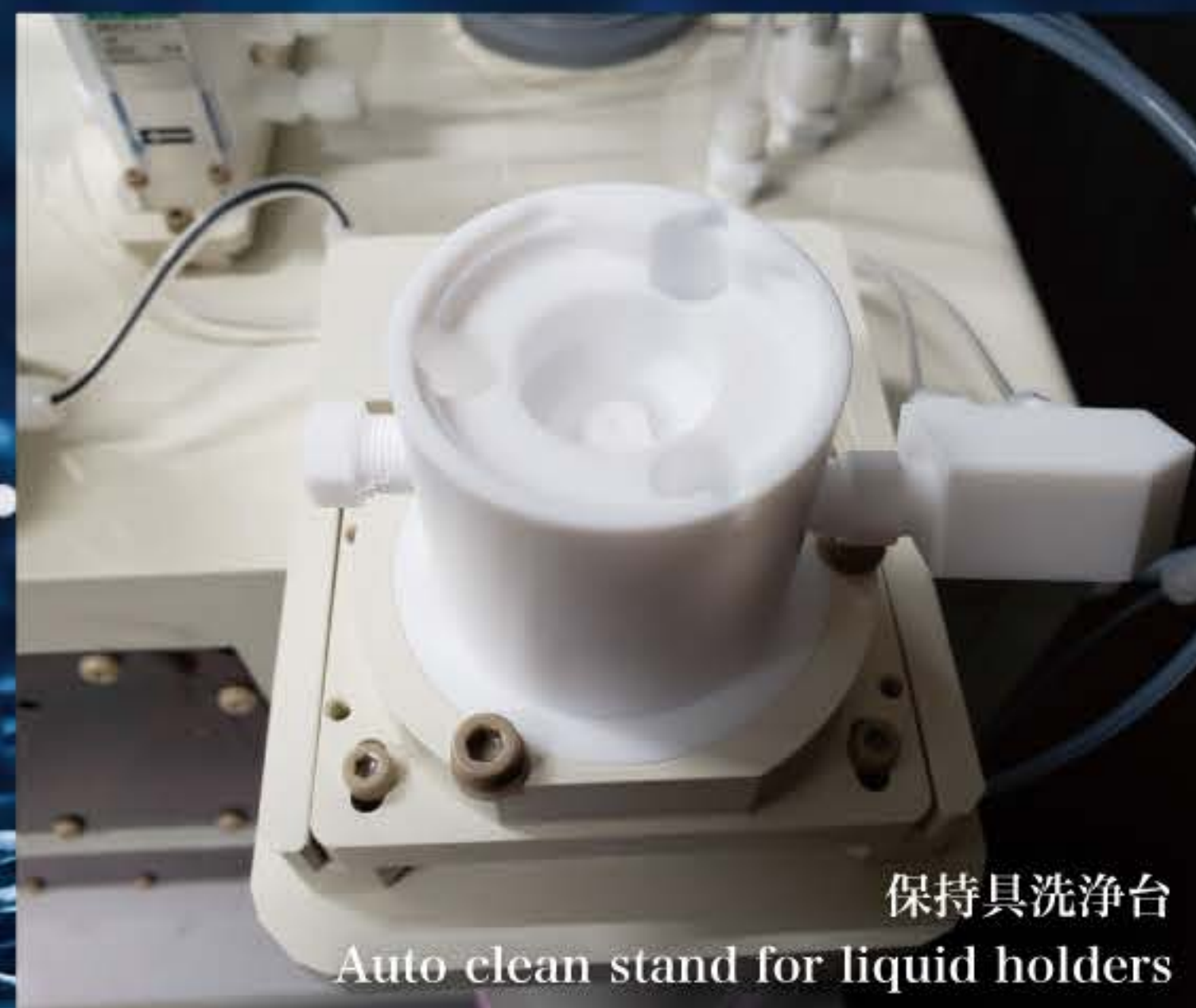


SC-9200

簡易型微量金属汚染物質回収装置
Semi-Automated Recovery System of Nano Contaminants



保持具洗浄台

Auto clean stand for liquid holders

ポイント - Key Point

- 1 シリコンウェーハの表面や側面に付着している、微量な金属汚染物質を回収する画期的な装置。
The innovative device that collects nano metal contaminants remained to the surface and sides of silicon wafers.
- 2 回収保持具の自動洗浄機能が備わっており、人によるコンタミリスクを最小限に抑え、分析の精度を均一に保つことができる。
Equipped with an automatic cleaning function for a liquid holder, it can minimize the risk of human contamination & maintain consistent analytical precision.
- 3 化合物半導体ウェーハでも回収が可能。
Also applicable for Compound Semiconductor Wafer.

操作 Operation	パソコン ^{※3} PC ^{※3}	オリフラ処理 ^{※2} Orientation Flat ^{※2}	リング状、固定半径、側面の回収パターンに付加 Added to sampling pattern of Ring-shaped, Fixed Radius and Side (Bevel)
保持具の自動洗浄 Auto Cleaning of Liquid Holders	○	吸い上げ式液回収 Sucking-Up type Collection of Liquid	○
保持具の装着 / 脱着 Attaching / Detaching Liquid Holders	自動 Auto	親水面の回収 Sampling of Hydrophilic Surface	○
サンプリング溶液の供給 Supply of Sampling Liquid	自動 Auto	外形 (W×D×H) (mm) Size (W×D×H) (mm)	690×550×790
サンプリング溶液の回収 Collection of Sampling Liquid	自動 Auto	重量 Weight	55kg
基本回収パターン Basic Sampling Pattern	リング状、扇型、固定、半径、円弧 Ring-shaped, Fan-shaped, Fixed, Radius, Arc	使用場所 Recommended Environment	グリーンドラフト内 Inside Clean Draft
追加回収パターン ^{※1} Additional Sampling Pattern ^{※1}	側面、矩形、弓形 Side(Bevel), Rectangle, Circular Segment	必要ユーティリティ Utilities	電源 (AC100-240V)、純水、N2、クリーンドライエア AC-100-240V, DIW, N2, CDA

※1、2：オプションで別見積りになります ※3：パソコンは別見積りにて準備いたします *1-3:Those Options and PC will be quoted separately.